

20X bis 100X Multifunktionsplatte



Produkt #56-077 **AUSVERKAUF** 3 In Stock

- 1 + €2.175⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€2.175,00 stückpreis
Stk. 5+	€2.066,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1 x3	Größe (Zoll):
9.00	Dicke (mm):
±1.0	Gesamtgenauigkeit (µm):
1.00	Parallelität (Bogenminuten):

Optische Eigenschaften

Evaporated Chrome Pattern **Beschichtung:**

Fused Silica (Corning 7980) **Substrat:**

10-2 **Oberflächenqualität:**

3 - 4λ **Oberflächenebenheit (P-V):**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Konform **Reach 240:**

Produktdetails

- Entwickelt zur Kalibrierung von Messsystemen
- Ideal für Mikroskope und Systeme der industriellen Bildverarbeitung
- Beinhaltet konzentrische Kreise, Gitter, Strichgitter und lineare Mikroskala
- Zwei Platten für verschiedene Vergrößerungen erhältlich
- NIST-zertifiziert

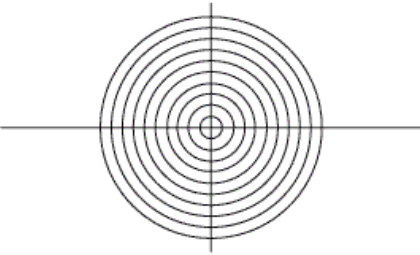
Mit einer einzigen Testplatte können alle Parameter eines Mikroskops und bildverarbeitenden Systems gemessen werden, ohne das weitere Testbilder benötigt werden. Ideal zur Kalibrierung und Messung von Auflösung, Verzeichnung und Schärfentiefe (DoF) unserer Mitutoyo- und Zeissmikroskopobjektive und anderer Objektive mit hoher Vergrößerung. Die Kalibrierungsplatten verfügen über Testfelder mit Liniengittern verschiedener Frequenzen, Gruppen mit Punkten und konzentrischen Kreisen unterschiedlicher Strichdicke und Abständen, eine Mikrometerskala und Kantenblöcke zum Aufbocken der Platte für DoF-Messungen. Eine Informationskarte, die komplette Anleitung auf CD und ein NIST-Zertifikat sind im Lieferumfang enthalten.

Die Kalibrierplatte mit niedrigen Frequenz eignet sich für optische Systeme mit 4X bis 20X Objektiven. Sie ist ideal für bildverarbeitende Systeme mit niedriger Vergrößerung und langen Arbeitsabständen.

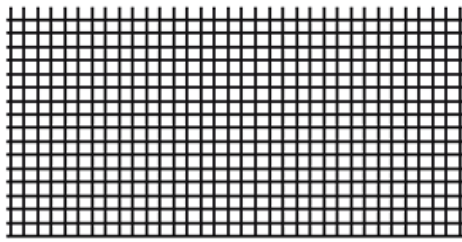
Die Kalibrierplatte mit hohen Frequenzen eignet sich für optische Systeme mit 20X bis 100X Objektiven. Sie ist ideal für Mikroskope und andere Systeme mit hoher Vergrößerung und kurzen Arbeitsabständen.

Technische Informationen

Outer Diameter (mm)	Line Spacing (mm)	Line Width (µm)
5.0	0.25	20
4.0	0.25	15
3.0	0.25	10
2.0	0.10	7.5
1.0	0.10	5



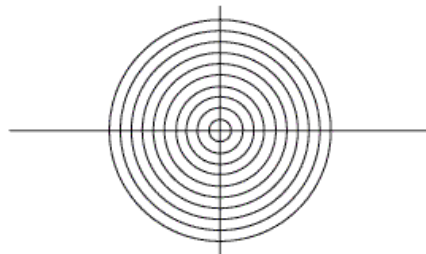
Width (mm)	Line Spacing (mm)	Line Width (µm)
4.5	0.25	20
4.5	0.25	15
4.5	0.25	10
4.5	0.10	15
4.5	0.10	10
4.5	0.10	5
2.55	0.075	10
2.55	0.075	5
2.55	0.050	5
2.55	0.050	2.5



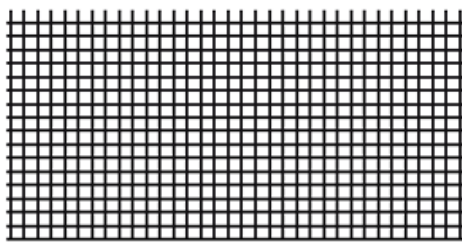
Range (lp/mm)	Frequency Change (lp/mm)
60 - 380	20

Length (mm)	Divisions/mm	Microns/divisions
0 - 68.2	20	50

Outer Diameter (mm)	Line Spacing (mm)	Line Width (µm)
3.0	0.25	10
2.0	0.10	7.5
1.5	0.10	5
1.0	0.05	5
1.0	0.05	2.5



Width (mm)	Line Spacing (mm)	Line Width (µm)
3.0	0.25	10
3.0	0.25	7.5
3.0	0.25	5
3.0	0.10	10
3.0	0.10	7.5
3.0	0.10	5
2.55	0.075	10
2.55	0.075	5
2.55	0.050	5
2.55	0.050	2.5



Range (lp/mm)	Frequency Change (lp/mm)
240 - 600	10

Length (mm)	Divisions/mm	Microns/divisions
0 - 68.2	20	50